

ПЛАН на выполнение НИР "Исследование морфологии и спектральных характеристик тонких пленок порфиринов"

1. Нанесение контактных слоев из проводящих материалов на поверхность образцов на основе производного порфирина при формировании сэндвичевых структур предназначенных для фотоэлектрических измерений
2. Исследование рельефа поверхности полученных образцов на основе производного порфирина методом атомно-силовой микроскопии (AFM) и интерферометрии белого света (WLI)
3. Измерение вольтамперных характеристик в высокочистой контролируемой атмосфере, в условиях различной освещенности, скорости и интервала развёртки.
4. Измерение оптических спектров пропускания полученных тонкопленочных структур на кварцевых подложках в диапазоне 190-1100 нм

Список оборудования и перечень услуг ЦКП ИФМ РАН для выполнения НИР "Исследование морфологии и спектральных характеристик тонких пленок порфиринов"

п/п	Наименование используемого Оборудования ЦКП ИФМ РАН	Пункт из перечня услуг(работ), указанного на сайте	Наименование работы	Стоимость работ 1час (в руб)	Расчетное время работ (в час)	Цена работы (в руб)
1	Установка для термического напыления металлов, диэлектриков, органических полупроводников	п.45	Нанесение тонкопленочных и многослойных покрытий с использованием установки термического напыления	7 000,00	60,0	420 000,00
2	Установка для измерения вольт-амперных характеристик	п.44	Измерение вольтамперных характеристик тонкопленочных структур в контролируемой инертной атмосфере (Ar) по H2O, O2 <1 ppm	4 000,00	100,0	400 000,00
3	Интерферометр белого света (Talysurf CCI2000)	п.17	Анализ поверхности с помощью интерферометра белого света	1 500,00	40,0	60 000,00
4	Спектрометр Genesys50	п.47	Исследование спектров пропускания	2 000,00	40,0	80 000,00
5	Атомно-силовой микроскоп CMM2000	п.48	Анализ поверхности с помощью атомно-силовой микроскопии	3 000,00	80,0	240 000,00
	ВСЕГО стоимость НИР				320,0	1 200 000,00